

Согласно результатам времязадерживающих экспериментов, для таких слоев $(\mu\tau) \approx (\mu\tau)_p = 5 \cdot 10^{-9} \text{ см}^2/\text{В}$. Полагая, что равенство $(\mu\tau)_p \approx (\mu\tau)$ справедливо и в стационарном состоянии, из экспериментальной величины стационарной фотопроводимости при $\Delta E = 1 \text{ эВ}$ [3] имеем $(\mu\tau)_p = 5 \cdot 10^{-8} \text{ см}^2/\text{В}$. Квазистационарную фотопроводимость мишени видикона (время пролета дырок $\sim 10^{-6} \text{ с}$, время считывания сигнала $4 \cdot 10^{-2} \text{ с}$), очевидно, ограничивает некоторая промежуточная величина $(\mu\tau)_p$. Таким образом, для данного случая $5 \cdot 10^{-9} \leq (\mu\tau)_p \leq 5 \times 10^{-8} \text{ см}^2/\text{В}$.

На рис. 2 приведены ВАХ двух мишеней при освещении белым светом, когда вклад в фототок дают не только дырки, но и электроны. Однако начало области насыщения фототока при освещении мишени светом $\lambda = 417 \text{ нм}$, когда ток можно считать исключительно дырочным [2], фактически совпадает с показанным на рис. 2. Поэтому можно считать, что и в рабочих условиях мишени вклад дырок преобладает. Этого нельзя было сказать об исследованных ранее мишенях, у которых дырочный ток не насыщался вплоть до напряжения на мишени 15 В [2], в то время как ток при освещении белым светом выходит на насыщение (рис. 2). Для мишеней, исследованных в настоящей работе, по началу насыщения ВАХ, когда $(\mu\tau)_p E \gg d$, (E — напряженность электрического поля), можно оценить $(\mu\tau)_p \gg 10^{-9} \text{ см}^2/\text{В}$. Это согласуется с результатом оценки $(\mu\tau)_p$, приведенным выше. Указанные величины удельного сдвига дырок должны обеспечивать низкие величины фотоэлектрической составляющей инерционности видикона. Отметим также, что насыщение фототока наступает при полях ниже 10^5 В/см , когда величины темнового тока малы (рис. 1) и он не может ограничивать ток сигнала прибора. Кроме того, при таких полях еще не появляются «белые пятна» на мишени за счет локальных пробоев.

Из рис. 2 следует, что чувствительность мишени составляет максимально $S = 2000 \text{ мкА/лм}$ (площадь сканирования мишени электронным лучом $\sim 1 \text{ см}^2$). Согласно [4], такая величина мишени на основе $a\text{-Si : H}$ соответствует квантовой эффективности во всем видимом диапазоне, близкой к 100 %.

Список литературы

- [1] Голикова О. А., Мездрагина М. М., Петров И. Н., Казанин М. М., Сорокина К. Л. // Письма ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 4. С. 85—87.
- [2] Голикова О. А., Заец А. И., Казанин М. М., Петров И. Н. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 4. С. 768—771.
- [3] Голикова О. А., Бабахаджаев У. С., Казанин М. М., Мездрагина М. М., Арлаускас К., Юшка Г. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 7. С. 1190—1193.
- [4] Nesladek M., Kočka J., Vanček M., Stuchlík J., Stíka O., Dlouhý J., Sipek E., Jedlička M. // J. Non-Cryst. Sol. 1987. V. 90. P. 251—254.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получено 18.06.1990
Принято к печати 21.06.1990

ФТП, том 25, вып. 1, 1991

ФОТОСТИМУЛИРОВАННОЕ НЕЧЕТНОЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКА ПРИ РАССЕЯНИИ ЭЛЕКТРОНОВ ЗАРЯЖЕННЫМИ ПРИМЕСЯМИ

Железняк А. Т., Шмелев Г. М.

Теории поперечного магнитосопротивления (МС) полупроводника, находящегося в сильном линейно поляризованном ВЧ электрическом поле, посвящено немало работ (см. обзор в [1]). Интерес к этому вопросу вызывается, в частности, тем, что такое фотостимулированное (ФС) МС содержит и члены, нечетные по магнитному полю (Н). Это важное обстоятельство отражает нарушение

принципа Онзагера для систем в сильном ВЧ поле (в отсутствие «подсветки» МС — четная функция Н).

В связи с излагаемым ниже отметим работу [2], где в качестве причины существования нечетного МС (НМС) рассматривалось влияние ВЧ поля на вероятность рассеяния электронов, в том числе заряженными примесями. При этом поле центра считалось заданным, т. е. не зависящим от подсветки. Между тем в ВЧ поле потенциал экранированного электронами поля рассеивающего центра модифицируется: он спадает с расстоянием от заряда не экспоненциально (как в отсутствие ВЧ поля), а по степенному закону — как потенциал квадруполя [3].

В настоящем сообщении мы рассчитываем ФС НМС с одновременным учетом влияния подсветки как на вероятность примесного рассеяния, так и на экранирование поля самой заряженной примеси. Как будет показано далее, эти факторы дают вклады противоположного знака, что, в свою очередь, может привести к смене знака НМС при изменении частоты ВЧ поля.

Квантовое кинетическое уравнение для стационарной функции распределения n_p полностью вырожденного электронного газа, находящегося в постоянном (тянущем) электрическом (E), слабом постоянном магнитном и в ВЧ ($F(t) = F \sin \Omega t$) полях, имеет вид

$$[eE + \omega_B(p, h)] \frac{\partial n_p}{\partial p} = 2\pi e^2 N_i \sum_q \varphi_q^2 (n_{p+q} - n_p) \left[\left(1 - \frac{(aq)^2}{2} \right) \varepsilon^{-2}(q, 0) \delta(\varepsilon_p - \varepsilon_{p+q}) + \right. \\ \left. + \frac{(aq)^2}{4} \varepsilon^{-2}(q, -\Omega) \delta(\varepsilon_p - \varepsilon_{p+q} - \Omega) + \frac{(aq)^2}{4} \varepsilon^{-2}(q, \Omega) \delta(\varepsilon_p - \varepsilon_{p+q} + \Omega) \right], \quad (1)$$

где $\omega_B = eH/(mc)$ — циклотронная частота, N_i — концентрация рассеивающих центров, $a = eF/(m\Omega^2)$, e , p , m — заряд, канонический импульс и эффективная масса носителя, $\varepsilon_p = p^2/(2m)$, $\varphi_q = 4\pi Q/(\epsilon_0 q^2)$, Q — заряд центра, ϵ_0 и $\varepsilon(q, \Omega)$ — диэлектрическая проницаемость решетки и электронного газа соответственно, $h = H/H$, $\hbar = 1$. Уравнение (1), выведенное методом корреляционных функций в приближении хаотических фаз для бесстолкновительной плазмы, отличается от соответствующего уравнения в [2] учетом зависимости $\varepsilon(q, \Omega)$ от частоты Ω [формула для $\varepsilon(q, \Omega)$ имеется в [4]]. Уравнение (1) получено в линейном приближении по интенсивности подсветки, которая входит явно лишь в интеграл столкновений; при этом считается, что выполнено условие $\Omega\tau \gg 1$ (τ — время релаксации импульса электрона). Кроме того, уравнение (1) справедливо при $\omega_B \ll \Omega$ и $\omega_B \ll \varepsilon_F$ [1], где $\varepsilon_F = p_F^2/(2m)$ — энергия Ферми. Далее рассматривается случай, когда $\Omega \gg \varepsilon_F$, но, с другой стороны, $\Omega < \varepsilon_g$ — ширины запрещенной зоны.

Следуя [1, 2], в линейном приближении по магнитному полю, тянувшему полю находим выражение для тензора электропроводности

$$\sigma_{ik} = \sigma_0 \delta_{ik} - \omega_B \tau(\varepsilon_F) \sigma_0 \varepsilon_{ikl} h_l + 2\pi N_i \left(\frac{eQ}{\epsilon_0} \right)^2 \frac{\sigma_0 \beta}{\Omega} \left[\delta_{ik} (A + B + C) + \right. \\ \left. + 2e_i e_k (A + C) - \omega_B \varepsilon_{ikl} h_l (2A\tau(\varepsilon_F) + B(2\tau(\varepsilon_F) + \tau(\Omega))) + \right. \\ \left. + C(\tau(\varepsilon_F) + \tau(\Omega)) \right] - \omega_B \varepsilon_{ikm} h_l e_m e_i (2\tau(\varepsilon_F)(A + C)) - 2\omega_B \varepsilon_{ilm} h_l e_k e_m \times \\ \times \{ A\tau(\varepsilon_F) + C\tau(\Omega) \}], \quad (2)$$

$$A = \frac{2\tau(\varepsilon_F) I}{5p_F}, \quad (3)$$

$$I = \frac{1}{2p_F^2} \int_0^{2p_F} \frac{q dq}{\varepsilon^2(q, 0)} \approx 1 + \frac{x^2}{(2p_F)^2 + x^2} + \frac{x^2}{2(2p_F)^2} \ln \left(\frac{|x|}{x^2 + (2p_F)^2} \right), \quad (4)$$

$$B = \frac{2(\tau(\Omega) - \tau(\varepsilon_F))}{3\sqrt{2m\Omega}}, \quad (5)$$

$$C = -\frac{2\pi(\Omega)}{15\sqrt{2m\Omega}} \left(1 - \frac{x^2}{m\Omega}\right), \quad (6)$$

$$\tau^{-1}(\epsilon_p) = 2\pi e^2 N_i \sum_{p'} \varphi_{p-p'}^2 (1 - \cos \theta) \epsilon^{-2}(p - p', 0) \delta(\epsilon_p - \epsilon_{p'}), \quad (7)$$

здесь $x = (6\pi n e^2 / (\epsilon_0 \epsilon_F))^{1/2}$ — обратный радиус экранирования Томаса—Ферми, $\sigma_0 = e^2 n \tau(\epsilon_F) / m$, $\beta = e^2 F^2 / (m\Omega^3)$, n — концентрация электронов проводимости, ϵ_{ikl} — единичный антисимметричный тензор, $e = F/F$. В интеграле (4) мы положили $\epsilon(q, 0) = 1 + x^2/q^2$, что справедливо лишь вблизи $q=0$ [5].

Далее считаем, что ось $OZ \parallel H$, ось OX направлена вдоль постоянного тока (во всех остальных направлениях образец гальванически разомкнут), а вектор e лежит в плоскости XOY . Тогда удельное сопротивление

$$\rho(H) = \frac{\sigma_{yy}(H)}{\sigma_{xx}(H)\sigma_{yy}(H) - \sigma_{xy}(H)\sigma_{yx}(H)}. \quad (8)$$

Подставляя (2) в (8) и учитывая (6), находим в линейном приближении по H

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\rho(H) - \rho(0)}{\rho(0)} = \frac{4\pi}{15} N_i \left(\frac{eQ}{\epsilon_0}\right)^2 \frac{\beta\omega_H \tau(\Omega)}{\sqrt{2m\Omega^3}} (\tau(\Omega) - \tau(\epsilon_F)) \left[1 - \frac{x^2}{m\Omega}\right] \sin 2\alpha, \quad (9)$$

здесь α — угол между e и направлением постоянного тока. Формула (9) отличается от соответствующего результата работы [2] множителем $[1 - x^2/(m\Omega)]$, что обусловлено учетом зависимости потенциала рассеивающего центра от поля электромагнитной волны.

Сделаем численные оценки применительно к n -GaAs. Параметр $x^2/(m\Omega) = 1$ и, стало быть, $\Delta\rho/\rho = 0$ при $n = 5.4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$, $\epsilon_F = 7.75 \cdot 10^{-3} \text{ эВ}$, $\Omega = 6 \cdot 10^{13} \text{ с}^{-1}$, а $x^2/(m\Omega) = 2$ при $n = 1.9 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$, $\epsilon_F = 3.8 \cdot 10^{-3} \text{ эВ}$ и $\Omega = 3 \cdot 10^{13} \text{ с}^{-1}$. Таким образом, смена знака НМС возможна при вполне реальных значениях частоты подсветки и концентрации электронов. Если, например, полупроводник некомпенсирован ($n = N_i$), то для случая, когда $x^2/(m\Omega) = 2$, $\tau(\Omega) = 6.3 \cdot 10^{-11} \text{ с}$, и при $\omega_H = 5 \cdot 10^9 \text{ с}^{-1}$, $F = 2.4 \cdot 10^4 \text{ В/см}$ величина $\Delta\rho/\rho = 1.2 \%$.

Список литературы

- [1] Эштейн Э. М., Шмелев Г. М., Цуркан Г. И. Фотостимулированные процессы в полупроводниках. Кипинев, 1987. 168 с.
- [2] Малевич В. Л., Эштейн Э. М. // ФТТ. 1976. Т. 18. В. 5. С. 1286—1289.
- [3] Балкарей Ю. И., Эштейн Э. М. // ФТТ. 1972. Т. 14. В. 3. С. 741—745.
- [4] Либшиц Е. М., Питаевский Л. П. Физическая кинетика. М., 1979. 528 с.
- [5] Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М., 1966. 416 с.

Институт прикладной физики
АН ССР Молдовы
Кипинев

Получено 14.02.1990
Принято к печати 10.09.1990

ФТП, том 25, вып. 1, 1991

О СВЯЗИ ПИКОВ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ИК ПОГЛОЩЕНИЯ В a -Si : H

Спирин А. И., Понарина Е. И., Бенджубов В. Е.,
Захаров Ю. В., Селезнев А. Е., Кириллов В. И.

В настоящей работе проведены исследования оптических свойств пленок гидрогенизированного аморфного кремния a -Si : H, полученных методом разложения моносилана в ВЧ тлеющем разряде. Были измерены оптическое поглощение и фотолюминесценция (ФЛ). Образцы для измерения оптического поглощения в видимом диапазоне спектра получены осаждением пленок a -Si : H